

HELIOS 5 CX FIB-SEM (Odaklanmış İyon Işınlı Taramalı Elektron Mikroskobu)



Başlıca Uygulamalar

- SEM tabanlı yüksek çözünürlüklü yüzey görüntüleme
- FIB ile lokal kesitleme ve numune hazırlama
- Mikroyapı ve faz analizleri
- Kaplama, ince film ve arayüz incelemeleri
- TEM lameli hazırlama

Numune Tipleri

- Metal ve metal alaşımı numuneleri
- Seramik ve kompozit malzemeler

Teknik Özellikler

- FIB-SEM (Odaklanmış iyon ışını + taramalı elektron mikroskobu)
- **Elektron Işını Performansı**
- **Optimum WD'de çözünürlük:**
- 0,6 nm - 30 kV (STEM)
- 0,6 nm - 15 kV
- 1,0 nm - 1 kV
- 0,9 nm - 1 kV (ışın yavaşlaması ile)
- **Çakışma noktasında çözünürlük:**
- 0,6 nm - 15 kV
- 1,5 nm - 1 kV (beam deceleration ve DBS ile)

FSMVÜ HALIÇ YERLEŞKESİ, ALÜMİNYUM TEST EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi, Haliç Yerleşkesi Sütlüce Mahallesi Halicioğlu Kavşağı No:12 Beyoğlu/İstanbul

☎ 0212 521 81 00-Dahili:4373

✉ aluteam@fsm.edu.tr

🌐 aluteam.fsm.edu.tr